

OPZ Stanowisko mikroskopowe do ostrzowych pomiarów scalonych układów półprzewodnikowych

Stanowisko mikroskopowe do elektrycznych ostrzowych pomiarów scalonych układów półprzewodnikowych. Modułowa konstrukcja umożliwiającą rozbudowę. Magnetyczna podstawa do montażu manipulatorów sond ostrzowych. Przynajmniej cztery standardowe sondy ostrzowe na manipulatorach x,y,z. Platforma pomiarowa z możliwością podciśnieniowego montażu przynajmniej 3-calowych podłoży półprzewodnikowych oraz ich fragmentów. Dedykowana pompka próżniowa w zestawie. Platforma z możliwością separacji sond ostrzowych na poziomie 200 μm oraz z możliwością obniżenia do 40 mm. Platforma wysuwana na czas montażu struktur do pomiaru. Ruch X/Y platformy pomiarowej z pozycjonowaniem z rozdzielczością $< 5 \mu\text{m}$ oraz blokadą osi dla łatwej nawigacji liniowej. System wibroizolacyjny Mikroskop na uchwycie współosiowym o powiększeniu co najmniej 100x wraz z doświetleniem LED obszaru obserwowanego. W zestawie z okablowaniem wyprowadzającym sygnał z/do sond ostrzowych.

Stanowisko EPS150COAXPLUS lub tożsame.

20.06.2023 r.

Domian
Ruch